論文の内容の要旨

論文題目 STM を用いた単分子コンダクタンス測定に対する エネルギー安定性の影響の研究

氏 名 谷林 慧

1 背景

最も身近なナノスケール構造物である 分子にデバイスやワイヤーの役割を担わ せる分子エレクトロニクスは、その実現 が大いに嘱望されている。故に、BDT

(Benzene-DiThiolate, S-C₆H₄-S)等の構造 の単純な分子と対向する2つのAu電極か ら成る単分子架橋系をデバイスやワイヤ ーのプロトタイプとして使用した研究が、 内外で盛んに行われている。

しかしながら、これまでに報告されて いる電気伝導特性の実験例の中で、信頼 出来るものはわずかである。その最大の 理由は、「測定値が間違いなく単分子架 橋のものであるという証拠を提示するこ とが、極めて困難であること」である。 この点を克服した実験例として、Xiao ら による STM ブレークジャンクション法を 用いた実験が知られている[1]。これは、 分子溶液中で基盤に圧着された STM プロ ーブを引き離す過程でのコンダクタンス 変化を1000回程度繰り返し測定し積算し て得られるヒストグラムの第 1 ピーク値 から、単分子架橋のコンダクタンスを得 る実験手法である。彼らは BDT 溶液に対 してこの手法を適用することによって、 単位 BDT 架橋のコンダクタンスとして $0.011G_0$ (G₀=2e²/h) を得た。この数値は、 以前のReedらの実験値とは異なり[2]、最 近の理論計算とオーダー的に良く合って いる [3]。さらに、「コンダクタンス・ヒ ストグラム中の第 n ピーク値を n で規格 化した(G/n)と測定バイアス V から求めた *I*=(*G*/*n*)*V*カーブが、*n*に全く依存しない」 という結果を得ている。これは、第 n ピ ーク値が、電極間に並列に存在する n 本 の単位 BDT 架橋によって与えられている ことを示す強力な証拠であるといえる。

しかしながら、単分子架橋系のコンダ

クタンスを十分理解できたとはまだいえ ない。特に大きな問題は、理論計算で STM プローブを引き離していった際にコンダ クタンスが一旦大きく増大した後に減少 し、架橋切断時にゼロになると予想され ているのに対し、実験ではこのような振 る舞いが見られていない点である。

そこで本研究では、STM プローブ引き 離し時の架橋構造について実験的にも理 論的にもまだ十分には検討されていない ことに着目し、この点を第一原理計算を 用いて明らかにすることにより上記の問 題を解明することを目指した。

2 計算方法

電子状態の計算には、密度汎関数法 (DFT)を用いた。採用した交換・相関 エネルギー汎関数は、B3PW91である。

コンダクタンスの計算には、グリーン 関数法を用いた。また、電極の表面グリ ーン関数の計算には、Tada らの考案した Gaussian broadening 法を使用した[4]。この 手法は、分子-表面の境界付近に存在する 原子のみを含む小さなクラスターモデル から表面グリーン関数を効率良く求める ことを可能にする手法である。

基底関数には、LanL2DZ、および CEP-31Gの2種類を使用した。前者を安 定構造や全エネルギーの計算に、後者を コンダクタンスの計算に、それぞれ使用 した。

3 クラスターモデルの選択

単位 BDT 架橋を構成する 2 つの Au 電 極は、FCC 結晶構造を持つ。また、BDT は、それらの(111)表面(Au(111)表面)に 吸着する。これを表す必要十分なクラス ターモデルを選択するために、表面の大 きさと層数の異なる計 10 種類のクラスタ ーモデルを用意し、これらの第 1 層表面 上に定義された 5 種類の吸着サイト (on-top、bridge、hollow、fcc、hcp)上に 吸着した S-C₆H₄-SH の安定構造および吸 着エネルギーを比較した。さらに、Nara らがより大規模な 4 層スラブモデルを用 いて求めた計算結果[5]とも比較した。そ の結果、1)2 層以上の層構造の確保が必 要であること、2)表面の大きさは比較 的小さくても実用的に十分であること、 の2 点が明らかになった。

そこで、以下の第4章および第5章の 計算では、2電極系である単位 BDT 架橋 を組み立てた際の計算コストを抑えるた めに、表面最外層のAu原子8個と第2層 のAu原子5個を含む2層構造モデル Aug/Au5を採用した。

4 単位 BDT 架橋の安定構造とコンダク タンス

STM ブレークジャンクション実験で得 られるコンダクタンス曲線(STM プロー ブ引離しに伴うコンダクタンス変化)上 の各点の示す測定値は、1 つの架橋構造に 対するコンダクタンスではなく、複数の 架橋構造に対するコンダクタンスが各々 の実現確率によって重み付け平均された 期待値であると考えるのが妥当である。 なぜならば、室温の測定では、複数の架 橋構造間の構造遷移の速度が STM プロー ブの移動速度に比べてはるかに大きいた めに、架橋構造ゆらぎからの影響は平均 化された形で測定値に反映される可能性 が高いからである。しかしながら、単位 BDT 架橋のコンダクタンスについて、こ のような構造揺らぎを考慮した期待値の 計算例はまだ存在しない。

そこで本章では、各々の架橋構造の実 現確率が対応する形成エネルギーのボル ツマン因子に比例すると考えて、コンダ クタンスの期待値を計算した。このため にまず、図1に示す単位 BDT 架橋の8種 類の構造に対する形成エネルギー $E_{form} = E(Au_8/Au_5 + BDT + Au_8/Au_5) - {E(Au_8/Au_5) + E(BDT) + E(Au_8/Au_5)} を求めた。いずれも、$ $Au_8/Au_5 とその第1層表面上に設定された$ 4 種類の吸着サイトのいずれかに吸着した S-C₆H₄-SH から成る 1 電極系の最適化構造を基に、C₆ 環の中心点に対する反転操作を施すことによって組み立てたものである。tilted と perpendicular の違いは、前者では S-C₆H₄-SH の傾きを最適化しているのに対して、後者では表面に対して垂直に拘束している点である。



次に、 $E_{form} < 0$ を満たす構造に対してコ ンダクタンスを計算した。最後に、具体 的な電極間距離として l=11.00Å を与えた ときの単位 BDT 架橋のコンダクタンス期 待値を計算した。これは、コンダクタン ス曲線(以下ではトレースカーブと呼ぶ) 上の具体的な 1 点を計算で求めたことに 相当する。l = 11.00Å を選んだ理由は $E_{form} < 0$ を満たす perpendicular 構造である (bridge,bridge)、(fcc,fcc)、および(hcp,hcp) の 3 者では、l を最適化した値がいずれも 11.00 ± 0.11 Å の範囲に収まっていたため である。

図 1 の各構造の形成エネルギーとコン ダクタンスの計算結果の比較から、まず 安定な構造とコンダクタンスの大きな構 造が一致していないことがわかった。次 に期待値計算の結果、 $0.029 G_0$ が得られた。 これは、l = 11.00Åにおける(fcc,fcc)のコ ンダクタンスの計算値 $0.028 G_0$ にほぼ一 致する。その理由は、l=11.00Å における 形成エネルギーより得られる (bridge,bridge)、(fcc,fcc)、および(hcp,hcp) のボルツマン因子の比が、1: 4300: 120 で あり、(fcc,fcc)の因子が残り 2 つを圧倒し ているからである。このことは、*l*=11.00Å では、コンダクタンス・トレースカーブ 上の測定値が、事実上(fcc,fcc)のみによっ て与えられることを示唆しているといえ る。そこで、この*l*=11.00Å における (fcc,fcc)を、第5章でコンダクタンス・ト レースカーブを計算する際の初期構造に 採用した。

5 コンダクタンス・トレースカーブに対 するエネルギー安定性の影響

既に述べたように、BDT 架橋のコンダ クタンスの振る舞いについては、実験と 計算との間に未解決の大きな食い違いが 見られる。Xiao らの実験で報告されてい る BDT 架橋のコンダクタンス・トレース カーブは、0.011G₀付近にプラトーを示し ている[1]。それに対して、Xue らの理論 計算で報告されているコンダクタンス・ トレースカーブは、単位 BDT 架橋の電極 間距離の増大に伴いシャープなピークを 示している[6]。彼らは、最適化された電 極間距離Δl=0 では Xiao らの実験値 0.011G₀に近い 0.07G₀を報告しているが、 ピークに対応する*Δl*=1.5 Å では 0.40G₀と いう極めて大きな数値を報告している。 また、Keらの理論計算も同様のカーブを 報告している[7]。

Xue らや Ke らの理論計算[6,7]の最大の 問題点は、各ΔI で形成される BDT 架橋の 過渡構造について十分な検討を行ってい ない点である。すなわち、他により安定 な構造があるか否かについてほとんど考 慮していない。そこで、本研究では、各 ΔI の過渡構造を与えるプロセスとして図 2 に示す 3 種類を設定し、コンダクタンス 期待値を求めた。

プロセス a では、2 つの S-Au(111)表面 間の間隙が等しく引き伸ばされる。これ は、Ke らの採用したプロセスに等しい [7]。プロセス b では、1 つの間隙のみが 引き伸ばされる。これは、Xue らの採用 したプロセスに等しい[6]。また、 $\Delta l=0$ に おけるプロセス a、およびプロセス b の構 造は、いずれも、第4章で述べた l=11.00Å における(fcc,fcc)に等しい。プロセス c で は、プロセス b と同様に Au(111)表面と間 の間隙のみが引き伸ばされる。しかしな がら、BDT の傾きは、Au₈/Au₅ と S-C₆H₄-S から成る 1 電極系の示す BDT の傾きに固 定されている。これは、本研究で新たに 追加されたプロセスである。追加の理由 は、 $\Delta l = \infty$ の極限では、BDT は宙に浮いて いるよりもどちらか片方の電極に吸着し て 1 電極系を成した方が安定であること が容易に予想できるからである。



図2 BDT ジャンクションの過渡構造を 与えるプロセス a、b、および c。

本研究で計算された得られたコンダク タンス・トレースカーブを、図3下図の 実線に示す。これは、図3上図に示すプ ロセスa、b、およびcの形成エネルギー と、図3下図に示すコンダクタンスから 計算された期待値のΔl依存性である。プ ロセスaおよびbのコンダクタンスは、 それぞれKeらおよびXueらの報告からの 引用である[6,7]。挿入図は縦軸を実スケ ールに改めたものであり、Xiaoらの実験 で得られたコンダクタンス・トレースカ ーブと定性的に良く一致しているといえ る。

このコンダクタンス・トレースカーブ を、プロセス a、b、および c のコンダク タンスと比較すると、Xue らや Ke らの理 論計算[6,7]で見られたコンダクタンス・ トレースカーブのシャープなピークが Xiao らの実験[1]では見られない理由が、 コンダクタンス期待値を支配するプロセ スが 0.4<Δ/ <0.8 Å で a から c に遷移した ことであるといえる。



図 3 形成エネルギー、マリケンスピン密 度、およびコンダクタンスのΔ*l* 依存性。

6 総括

本研究では、単分子架橋系の STM プロ ーブ引き離しに伴う構造変化をエネルギ ー安定性の面から考察し、さらに各プロ ーブー電極間距離における構造揺らぎを 考慮したコンダクタンス期待値の計算を はじめて行った。その結果、これまでプ ローブー電極間距離変化に伴うコンダク タンス変化の振る舞いについて実験と理 論計算とで大きな不一致が見られていた のに対し、Xiao らの実験と定性的に良く 一致するコンダクタンス・トレースカー ブを得ることができた。このことは、STM ブレークジャンクション実験で得られる コンダクタンス・トレースカーブの理解 には、架橋構造のエネルギー安定性に対 する考察が不可欠であることを示唆して いる。よって、今後様々な単分子架橋系 に対する研究を進める上で、本研究のア プローチは大変有用であると期待される。

[1]X. Xiao et al.: Nano Lett. 4 (2003) 267.
[2]M. A. Reed et al.: Science 278 (1997) 252.
[3] J. Nara et al.: J. Chem. Phys. 121 (2004) 6485.

[4]T. Tada et al.: J. Chem. Phys. 121 (2004)

8050.

[5]J. Nara et al.: J. Chem. Phys. **120** (2004) 6705.

[6]Y. Xue and M. A. Ratner: Phys. Rev. B **68** (2003) 1221.

[7] S. Ke et al.: J. Chem. Phys. **122** (2005) 074704.